

# (十五) 國立臺灣大學園藝暨景觀學系

## 掃描電子顯微鏡管理規則

83年3月11日系務會議通過

87年3月6日系務會議修正通過

- 一、本室提供掃描電子顯微鏡主機以及覆膜機、臨界點乾燥器兩種週邊設備。  
掃描式電子顯微鏡 (SEM, ABT-60)  
覆膜機 (BioRad SC502 Sputter Coater)  
臨界點乾燥器 (Polaron Critical Point Drier)
- 二、本室之儀器以提供系內教師、研究生及研究助理使用為主。擬使用者必須修課或接受操作講習熟悉該儀器之性能，方可獨自操作。
- 三、本室各儀器原則上在上班時間使用。至於利用非上班時段使用者，則應以自認為有處理各儀器之突發狀況之能力者，且經楊雯如教授認可者為限。
- 四、凡欲使用本室各項儀器者，請於一週前先行向本室預約登記，但為避免長期佔用，各研究室每週以兩個半天為原則，唯若無人登記使用時，則可繼續登記使用。
- 五、儀器使用完畢應於登記簿上詳細記載使用者姓名、時數以及儀器使用狀況，並物歸原處，同時將週邊清理整潔。
- 六、儀器使用過程中，如遇有突發狀況無法解決時，請速通知楊雯如教授（分機 64843）。
- 七、為維持本室之正常運作，儀器之維護及消耗器材之花費等開支，每使用一個單元（一小時），收取成本費新臺幣參佰元，標本臨界點乾燥（每次陸佰元）與鍍金收費（每次肆佰元）未超過四十小時而燈絲損壞者，由操作者負擔不足四十小時之燈絲價格（每支燈絲目前售價壹仟貳佰元）。以上計費標準應由使用者負擔。
- 八、材料之製備、底片及其沖洗則請自理。
- 九、本規則經過系務會議通過實施，修正時亦同。